Schottky emission cathode used in electron beam lithography has a heating wire, a single crystal needle, and a supply of zirconium dioxide and a phasestabilizing element

Patent Number:

DE10029840

Publication date:

2001-01-04

Inventor(s):

DUVAL PAUL J (US)

Applicant(s):

SCHLUMBERGER TECHNOLOGIES INC (US)

Requested Patent:

DE10029840

Priority Number(s):

Application Number: DE20001029840 20000616 US19990343107 19990629

IPC Classification:

H01J1/28; H01J9/02; H01J37/06

EC Classification:

H01J1/144, H01J1/28, H01J37/06

Equivalents:

FR2795861, JP2001052596

Abstract

Schottky emission cathode has a heating wire (2) made of first heat-resistant metal, a single crystal needle (1) made of a second heat-resistant metal and connected to the wire, and a supply of ZrO2 (3) and a phase-stabilizing element on the needle, wire or connection between the needle and the wire. An Independent claim is also included for a process for stabilizing a ZrO2 supply of a Schottky emission cathode. Preferred Features: The first and second heat-resistant metal is tungsten with a orientation. The phase-stabilizing element or the connection is made of CaO, MgO or Y2O3.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

THIS PAGE BLANK (USPTO)





BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

Offenlegungsschrift

® DE 100 29 840 A 1

(1) Aktenzeichen:

100 29 840.0

② Anmeldetag:

16. 6. 2000

(3) Offenlegungstag:

4. 1. 2001

(f) Int. CI.⁷: H 01 J 1/28 H 01 J 9/02 H 01 J 37/06

③ Unionspriorität:

343107

29.06.1999 US

(7) Anmelder:

Schlumberger Technologies Inc., San Jose, Calif.,

(4) Vertreter:

Rüger und Kollegen, 73728 Esslingen

(72) Erfinder:

Duval, Paul J., Lexington, Mass., US

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- (§) Schottky-Emissions-Kathode mit einem stabilisierten ZrO₂-Vorrat
- Eine Schottky-Emissions-Kathode, die einen aus einem ersten hitzebeständigen Metall gefertigten Heizfaden, eine Einkristallnadel, die eine Facette aufweist, aus einem zweiten hitzebeständigen Metall hergestellt ist und mit dem Heizfaden verbunden ist, und einen Vorrat enthält, der wenigstens an der Einkristallnadel und/oder dem Heizfaden und/oder der Verbindung zwischen der Einkristallnadel und dem Heizfaden angeordnet ist. Der Vorrat enthält ZrO2 und ein phasenstabilisierendes Element oder eine Verbindung, das oder die eine Phase des ZrO₂ in dem Temperaturbereich von 293 bis 1800 Kelvin stabilisiert. Das phasenstabilisierende Element oder die Verbindung (i) stellt keine kontaminierende Substanz für die Einkristallnadel dar und (ii) setzt die Austrittsarbeit irgend einer anderen Kristallfacette der Einkristallnadel nicht wesentlich herauf.

Beschreibung

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Schottky-Emissions-Kathode, die einen stabilisierten ZrO₂ Vorrat aufweist. Im Speziellen ist die vorliegende Erfindung auf eine Schottky-Emissions-Kathode gerichtet, die einen ZrO₂-Vorrat und ein phasenstabilisierendes Element oder eine Verbindung, wie bspw. CaO, Y₂O₃ oder MgO, enthält.

In Einrichtungen, die Elektronenstrahlen nutzen, wie in einem Elektronenmikroskop oder in einem System zur Elektronenstrahllithografie, werden Elektronenquellen verwendet. Für solche Elektronenquellen ist eine Kathode erforderlich, die eine hohe Leuchtstärke ermöglicht, eine lange Lebensdauer und eine hohe Stabilität aufweist sowie eine akzeptable Ausbeute bei der Herstellung gestattet.

Wie in der US-PS 5.838.096 beschrieben, auf die hiermit verwiesen wird, ist in den kürzlich vergangenen Jahren die Verwendung einer als "Schottky-Kathode" bezeichneten Elektronenquelle aufgekommen, die eine höhere Leuchtstärke hat als die früher verwendete thermische Elektronen- 20 quelle aus LaB₆, einfacher zu handhaben ist als die zuvor angewandte Feldemissionsquelle aus W <310> und hinsichtlich der Elektronenemission stabil ist. In einer herkommlichen Schottky-Kathode ist an der Kathode selbst ein Vorrat mit Metall, bspw. Zirconium oder Titan, Sauerstoff 25 oder dgl. vorgesehen, der zur Bereitstellung von Atomen eines Metalls, Sauerstoff und dgl. für eine nadelförmige Einkristallspitze aus W <100> durch Thermodiffusion und zur Bildung einer Adsorptionsschicht dient, wodurch die Austrittsarbeit der Einkristallspitze herabgesetzt wird. Dies er- 30 möglicht eine stabile Elektronenstrahlung bei hoher Helligkeit oder Leuchtdichte. Falls eine solche Schottky-Kathode verwendet wird, wird an der Einkristallspitze aus W <100> ein elektrisches Feld angelegt und diese bei einer Temperatur zwischen 1000 und 2000 K geheizt, um thermisch ange- 35 regte Elektronen zu emittieren.

Bei einer Schottky-Kathode erfordert die Herstellung eines Vorrats zum Bereitstellen von an der Oberfläche einer nadelförmigen Einkristallspitze zu adsorbierenden Atomen eines Metalls zur Elektronenemission das Auftragen eines 40 Pulvers für den Vorrat und das Sintern durch Aufheizen im Vakuum bei einer hohen Temperatur.

In der US-PS 3.814.975, auf die hiermit verwiesen wird, ist ein Verfahren zur Ausbildung eines Vorrats zur Bereitstellung von Atomen eines Metalls beschrieben, die an der 45 Oberfläche einer Einkristallspitze adsorbiert werden, wobei ein Brei aus einem Pulver einer Hydrogenverbindung und Amylacetat aufgetragen und dann durch Aufheizen in einer sauerstoftreichen Umgebung bei einer hohen Temperatur gesinten wird.

Bei der Herstellung von Schottky-Emissions-Kathoden ist bereits bekannt, zur Erniedrigung der Austrittsarbeit des Wolframs einen ZrO₂-Vorrat an einem Wolframdraht anzuordnen.

1. W. Swanson und N. A. Martin, "Field Electron Cathode Stability Studies: Zirconium/Tungsten Thermal-Field Cathode", Journal of Applied Physics, 46, Mai 1975, 2029 2050, untersuchen die Verwendung der Feldelektronen-Kathode (FE-Kathode) als Elektronenquelle für gewerbliche Geräteanwendungen, wie bspw. das thermische Rasterelektronen-Mikroskop, und beschreiben insbesondere eine zirconiumbeschichtete Wolfram-Kathode (Zr/W-Kathode) als Thermalfeld-(TF-)Kathode in Bezug auf ihre Eignung, als FE-Kathode für Geräteanwendungen mit feinfokussiertem Elektronenstrahl zu dienen.

In L. R. Danielson und L. W. Swanson, "High Temperature Coadsorption Study of Zirconium and Oxygen on the W <100> Crystal Face", Surface Science, 88, (1979), 14–30,

ist festgestellt worden, dass das System Zr-O-W <100-> ein seltenes Beispiel für eine niedrige Austrittsarbeit (2,6 eV) darstellt.

Wie in H. S. Kim, E. Kratschmer, M. I., Yu, M. G. R.

Thomson und T. H. P. Chang, "Evaluation of Zr/O/W Schottky Emitters for Microcolumn Applications", (1994), 3413–3417, beschrieben, haben sich Schottky-Emissionsspitzen als geeignet erwiesen, einen Elektronenstrahl hoher Leuchtstärke mit für die konventionelle Elektronenmikroskopie und Elektronenstrahl-Lithografie guter Emissionsstabilität zu erzeugen. Kim et al. schlugen die Verwendung einer Zr/O/W-Schottky-Emissionsquelle als Alternative zu einer kalten (300 K) Feldemissionsquelle (monokristallines W) für Mikrosäulen zur gerichteten Feldemission (aligned field emission SAFE) für scannende Rastertunnelmikroskope (scanning tunneling microscope, STM) vor.

Die Zr/O/W-Punktkathode ist außerdem in Handbook of Charged Particle Optics, CRC Press, (1997), Seite 77–81, beschrieben worden.

Die Elektronen-Emissions-Eigenschaften einer Thermalfeld-Elektronen-(TFE)-Quelle, die einen <100> orientierten Wolfram-Emitter mit einem Überzug aus Zirconium enthält, wurde in L. W. Swanson und D. Tuggle, "Recent Progress in Thermal Field Electron Source Performance", Applications of Surface Science, 8, (1981), 185–196, berichtet.

Das CaO-ZrO₂-System ist in Craig R. Barrett et al., The Principles of Engineering Materials, (1973), S. 140–141 und in W. E. Kingery et al., Introduction to Ceramics, 2nd Edition, (1976), Seite 292, beschrieben.

Durch das Sol-Gel-Verfahren mit Y_2O_3 stabilisiertes ZrO_2 ist in Gianni Antonioli, Pier Paolo Lottici, Irano Manzini, Guglielmina Gnappi, Angelo Montenero, Fablo Paloschi und Philippe Parent, "An EXAFS Study of the Local Structure Around Zr Atoms in Y_2O_3 Stabilized ZrO_2 by Sol-Gel Method", Journal of Non-Crystal Solids, 177, 179–186 (1994) beschrieben.

Wie oben erläutert, verwenden typische Schottky-Emissions-Kathoden einen Vorrat an reinem Zirconiumdioxid (ZrO₂) als Quelle für ZrO an der Emissionsspitze (Jon Orloff, Charged Particle Optics, S. 78–81 (1997)). Schottky-Emissionsquellen werden gewöhnlich bei Temperaturen bis zu oder oberhalb von 1800° Kelvin betrieben. Die Zuführung von ZrO zu der Wolframspitze hat den Effekt, dass die Austrittsarbeit der Oberfläche herabgesetzt wird. Die niedrige Austrittsarbeit erlaubt es der Schottky-Emissionsquelle mit einem kleineren Feldgradienten als bei einer kalten Feldemissionsquelle eine ausreichende Anzahl von Elektronen zu bilden.

Bei vorhandenen Schottky-Emissionsquellen tritt das Problem auf, dass reines ZrO₂ einen Phasenwechsel zwischen der monoklinischen und der tetragonalen Phase zeigt, wenn das Material über die Grenztemperatur des Phasengleichgewichts hinaus erhitzt oder abgekühlt wird. Der Phasenwechsel ist mit einer erheblichen Volumenänderung verbunden, die Spannungen in dem ZrO₂-Vorrat verursacht. Diese Spannungen können zu Brüchen in dem ZrO₂ führen, wodurch eine Abtrennung des ZrO₂ von dem Wolframdraht hervorgerufen wird. Der Verlust des ZrO₂-Materials in dem Vorrat führt zu einer starken Abnahme der Anzahl der durch die Emissionsquelle produzierten Elektronen. Außerdem können Teilchen von ZrO₂, die von dem Wolframdraht losgelöst werden, zu einer Kontaminierung der Elektronenkanone führen.

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Risse oder Brüche in dem ZrO₂-Vorrat von Schottky-Emissions-Kathoden zu vermeiden.

Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, eine Abtrennung des ZrO₂ von dem Draht, bspw. dem Wolfram-

4

draht, bei Schottky-Emissions-Kathoden zu vermeiden.

Es wird auch angestrebt, eine Kontamination einer bei der Verwendung einer Schottky-Emissions-Kathode zugeordneten Elektronenkanone durch ZrO₂-Teilchen zu vermeiden.

Es wird als vorteilhaft angesehen, wenn es gelingt, den ZrO₂-Vorrat einer Schottky-Emissions-Kathode zu stabilisieren.

Die oben genannten Aufgaben, wie auch andere Aufgaben, Ziele und Vorteile werden durch die vorliegende Erfindung erfüllt.

Die Vorliegende Erfindung betrifft eine Schottky-Emissions-Kathode, die einen aus einem ersten hitzebeständigen Metall hergestellten Heizdraht, eine Einkristallnadel, die eine Facette aufweist, aus einem zweiten hitzebeständigen Metall hergestellt ist, das mit dem Heizdraht verbunden ist, 15 und einen Vorrat aufweist, der an der Einkristallnadel und/ oder dem Heizdraht und/oder einer Verbindung zwischen der Heizkristallnadel und dem Heizdraht angeordnet ist, wobei der Vorrat ZrO2 und ein phasenstabilisierendes Element oder eine Verbindung enthält, das oder die eine Phase des 20 ZrO₂ über einen Temperaturbereich von 293° bis 1800° Kelvin stabilisiert. Das phasenstabilisierende Element oder die Verbindung hat die folgenden Eigenschaften: (i) es oder sie kontaminiert nicht die Einkristallnadel und (ii) es oder sie erhöht die Austrittsarbeit irgend einer anderen Kristallfa- 25 cette der Einkristallnadel nicht wesentlich.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist außerdem ein Verfahren zur Stabilisierung eines ZrO2-Vorrats einer Schottky-Emissions-Kathode mit einem Heizdraht und einer Einkristallnadel, die eine Facette aufweist und mit dem 30 Heizdraht verbunden ist. Die vorliegende Erfindung verhindert eine Abtrennung von ZrO2 von dem Vorrat infolge von Brüchen des Vorrats und nachfolgende Kontamination durch große Teilchen des ZrO2, die an dem Heizfaden in der Nähe der Spitze der Einkristallnadel oder an der Einkristallnadel angelagert werden (kleine Teilchen von ZrO2, die durch Oberflächendiffusion aus dem Vorrat heraus die Nadel hinunter diffundieren, werden jedoch benötigt). Das Verfahren umfasst die Einbringung eines phasenstabilisierenden Elementes oder einer Verbindung in den ZrO2-Vorrat. Das 40 phasenstabilisierende Element oder die Verbindung stabilisiert eine Phase des ZrO2 über einen Temperaturbereich von 293 bis 1800 Kelvin. Das phasenstabilisierende Element oder die Verbindung (i) ist keine kontaminierende Substanz für die Einkristallnadel und (ii) erhöht die Austrittsarbeit ir- 45 gend einer anderen Kristallfacette der Einkristallnadel nicht

Zu Zwecken der Erläuterung der Erfindung sind in den Zeichnungen gegenwärtig bevorzugte Ausführungsformen veranschaulicht. Selbstverständlich ist die vorliegende Erfindung jedoch nicht auf die in den Zeichnungen dargestellten genauen Anordnungen und Mittel begrenzt. Es zeigen:

Fig. 1 die Vorderansicht einer Schottky-Emissions-Kathode gemäß der vorliegenden Erfindung,

Fig. 2 eine ausschnittsweise Darstellung einer Elektro- 55 nenkanone, die eine erfindungsgemäße Schottky-Emissions-Kathode enthält, in Vorderansicht, und

Fig. 3 eine detailliertere Darstellung der Spitze oder Nadel einer herkömmlichen Schottky-Emissions-Kathode, in Vorderansicht.

Der Aufbau einer erfindungsgemäßen Schottky-Emissions-Kathode wird nun anhand der folgenden, die Erfindung nicht einschränkenden Ausführungsformen beschrieben. Gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wie sie in Fig. 1 veranschaulicht ist, wird ein polykristalliner Wolframdraht mit einem Durchmesser von ungefähr 0,15 mm zu einem Heizfaden 2 mit einer haarnadelähnlichen Form geformt. Eine Einkristallnadel 1 aus Wol-

fram, die eine Kristallorientierung <100> aufweist, ist mit dem Scheitel des Zentralabschnittes des Heizfadens 2 verbunden, und ein Endabschnitt von dieser wird dann einem elektrochemischen Ätzvorgang in einer NaOH-Lösung ausgesetzt, um eine Spitze der Einkristallnadel 1 zu bilden. Ein Vorrat 3, der Zirconium und ein phasenstabilisierendes Element oder eine Verbindung enthält, ist an dem Heizfaden 2 angeordnet.

Der Vorrat 3 wird durch Beimischung eines Pulvers aus Zirconiumoxid und einem phasenstabilisierenden Element oder einer Verbindung zu einem Lösemittel zubereitet, um einen Brei zu bilden. Der Brei wird auf einen Scheitelabschnitt des Heizfadens 2, einen Zwischenabschnitt der Einkristallnadel 1 oder einen Grundabschnitt der Einkristallnadel 1 aufgebracht, um den Vorrat 3 zu bilden.

Das Bezugszeichen 4 kennzeichnet einen Anschluss, der vorzugsweise aus Edelstahl gefertigt ist und an den der Heizfaden 2 durch Punktschweißung angeschweißt ist, und das Bezugszeichen 5 kennzeichnet einen keramischen Isolator

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, wie sie in Fig. 2 dargestellt ist, ragt die Einkristallnadel 10 durch einen Suppressor (Fangelektrode) 11 hindurch aus diesem heraus. Der Suppressor 11 wird gewöhnlich in Bezug auf die Einkristallnadel 10 bei einer Spannung von 500 bis 1200 Volt gehalten. Ein Vorrat 13 an Zirconium und einem phasenstabilisierenden Element oder einer Verbindung ist an einem Filament 12 an einer der beiden in Fig. 2 gezeigten Positionen angeordnet. Das Bezugszeichen 14 kennzeichnet einen Heizfaden.

Fig. 3 zeigt im Detail den in der Nähe der Einkristallnadel 20 befindlichen Abschnitt einer herkömmlichen Schottky-Emissions-Kathode. ZrO₂-Teilchen, die aus dem Vorrat ausbrechen können (in Fig. 3 nicht veranschaulicht), können sich in der Nähe der Öffnung 22 in dem Suppressor 21 absetzen, durch die die Einkristallnadel 20 nach außen ragt. Solche ZrO₂-Teilchen können "Klumpen" 23 bilden, die das elektrische Feld in der Nähe der Einkristallnadel 20 verändern und verzerren und in der Form des Elektronenstrahls Brüche oder Verkürzungen verursachen können.

Vorzugsweise ist der Heizfaden für die vorliegende Erfindung aus einem Material hergestellt, das aus der aus W, Mo und Re bestehenden Gruppe ausgewählt ist. Die Einkristallnadel ist vorzugsweise aus einem Material hergestellt, das aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus W, Mo und Re besteht.

Bevorzugterweise ist der Heizfaden für die vorliegende Erfindung aus Wolfram gefertigt und die Einkristallnadel aus Wolfram hergestellt, das eine Kristallorientierung von <100> entlang der Achse der Nadel aufweist, wobei das Ende der Spitze eine Facette <100> ist.

Zu den Vorteilen der vorliegenden Erfindung, die eine Schottky-Emissions-Kathode betrifft, die einen Vorrat oder eine Beschichtung aus Zirconiumdioxid (ZrO₂) mit eingebrachter phasenstabilisierender Verbindung oder einem Element benutzt, gehören die Folgenden: eine beträchtliche Reduzierung des Zirconiumverlustes, eine wesentliche Verlängerung der Lebensdauer der Kathode, wenn die Betriebsbedingungen schnelles Zuschalten und Abschalten des Heizstroms für die Spitze ergeben, und eine verminderte Kontamination der Elektronenkanone.

Die Stabilisierung einer kristallinen Phase des Zirconiums durch die vorliegenden Erfindung verhindert Spannungen, die in dem Vorrat aufgrund der großen Volumenänderung hervorgerufen werden, die den Wechsel von einer monoklinischen kristallinen Phase zu einer tetragonalen kristallinen Phase begleitet, der Auftritt, wenn die Schottky-Emissions-Kathode von der Raumtemperatur bis auf die Betriebstemperatur (gewöhnlich 1800 K) erhitzt wird oder wenn die Spitze "abgeschaltet" und von der Betriebstemperatur auf die Raumtemperatur abkühlen gelassen wird, wobei sie einen Wechsel von der tetragonalen Struktur zurück zur monoklinischen Struktur vollzieht.

In der vorliegenden Erfindung kann jede Verbindung verwendet werden, die eine Phase des ZrO₂ über den Temperaturbereich von ungefähr 293 Kelvin bis 1800 Kelvin stabilisiert, die selbst kein Kontaminationsrisiko für die Elektronenkanone oder die Emissionsspitze darstellt und die die Austrittsarbeit der vorzugsweise aus Wolfram bestehenden Facette <100> nicht wesentlich heraufsetzt. Eine Wolframnadel (Einkristallnadel oder -spitze) mit erfindungsgemäß stabilisiertem ZrO₂ weist eine Austrittsarbeit von ca. 2,6 bis 2,95 eV an der Facette <100> auf, wohingegen für Wolfram alleine (bei einer herkömmlichen Vorrichtung) die Austrittsarbeit an der Facette <100> in etwa 4,7 eV beträgt.

Verbindungen, die den ZrO_2 entsprechend der vorliegenden Erfindung stabilisieren, enthalten CaO, Y_2O_2 und MgO. Zur Stabilisierung der tetragonalen Phase von Zirconiumdioxid ist beispielsweise eine Verbindung aus Y_2O_3 mit einer Konzentration von 3 mol-% bis 8 mol-% und vorzugsweise 3 bis 6 mol-% und ZrO_2 ermittelt worden.

Beispiel

Verfahren zur Herstellung einer Schottky-Emissions-Kathode mit einem ZrO₂ und eine phasenstabilisierende Verbindung enthaltenden Vorrat

(1) Ein Verfahren, das den in der US-PS 5.838.096 beschriebenen Vorschriften folgt, bei dem das angewandte Pulver jedoch stabilisiertes oder teilweise stabilisiertes Zirconiumdioxid ist. Das Pulver besteht in einer Linie aus einem Oxid des Zirconiums mit dem Zusatz eines Stabilisierungsmittels, bspw. eines Oxids von Yttrium, Magnesium oder Calcium.

Das Pulver aus stabilisiertem oder teilweise stabilisiertem Zirconiumdioxid kann verwendet werden, indem es mit einem organischen Bindemittel und einem Lösemittel vermischt wird, was dann auf eine geätzte Einkristall-Wolframnadel aufgebracht und getrocknet wird, bevor der Vorrat durch Aufheizen im Vakuum gesintert wird, wie es in der US-PS 5.838.096 beschrieben ist.

(2) Ein Verfahren, dass die Vorschriften befolgt, wie sie in der US-PS 3.814.975 beschrieben sind, bei dem das verwendete Pulver aber stabilisiertes oder teilweise stabilisiertes Zirconiumdioxid ist. Das Pulver besteht vor allem aus einem Oxid des Zirconiums mit dem Zusatz eines Stabilisierungsmittels, wie bspw. einem Oxid von Yttrium, Magnesium oder Calcium.

Das Pulver aus stabilisiertem oder teilweise stabilisiertem Zirconiumdioxid kann verwendet werden, indem es mit einem organischen Bindemittel oder einem Lössemittel vermischt wird, was anschließend auf eine geätzte Einkristall-Wolframnadel aufgebracht und trocknen gelassen wird, bevor der Vorrat durch Aufheizen im Vakuum gesintert wird, wie dies in der US-PS 5.838.096 beschrieben ist.

(3) Ein Verfahren, bei dem die Stabilisierung des ZrO₂-Vorrats dadurch erreicht wird, dass die Menge einer stabilisierenden Verbindung, die dem ZrO₂ beigefügt wird, derart ausreichend bemessen ist, dass ein Teil des ZrO₂ bei Zimmertemperatur entweder in einer 65 tetragonalen oder in einer kubischen kristallinen Form verbleibt.

Die vorliegende Beschreibung dient der Veranschauli-

chung und nicht der Einschränkung der Erfindung, und viele Modifikationen und Veränderungen können vorgenommen werden, ohne den Gegenstand und Geltungsbereich der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Patentansprüche

1. Eine Schottky-Emissions-Kathode, die aufweist: einen Heizfaden, der aus einem ersten hitzebeständigen Metall hergestellt ist,

eine Einkristallnadel, die eine Facette aufweist und aus einem zweiten hitzebeständigen Metall hergestellt ist, das mit dem Heizdraht verbunden ist, und

einen an der Einkristallnadel und/oder dem Heizfaden und/oder der Verbindung zwischen der Einkristallnadel und dem Heizfaden angeordneten Vorrat, der ZrO₂ und ein phasenstabilisierendes Element oder eine Verbindung enthält, das oder die eine Phase des ZrO₂ in einem Temperaturbereich von 293 bis 1800 Kelvin stabilisiert, wobei das phasenstabilisierende Element oder die Verbindung (i) keine kontaminierende Substanz für die Einkristallnadel darstellt und (ii) die Austrittsarbeit irgend einer anderen Kristallfacette der Einkristallnadel nicht erheblich heraufsetzt.

- 2. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 1, bei der das erste hitzebeständige Metall Wolfram ist.
- 3. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 2, bei der das zweite hitzebeständige Metall Wolfram ist.
- 4. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 3, bei der die Einkristallnadel Wolfram mit der Orientierung <100> ist.
- 5. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 1, bei der das phasenstabilisierende Element oder die Verbindung CaO ist.
- 6. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 1, bei der das phasenstabilisierende Element oder die Verbindung MgO ist.
- 7. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 1, bei der das phasenstabilisierende Element oder die Verbindung Y_2O_3 ist.
- 8. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 7, bei der die Konzentration des Y₂O₃ 3 bis 8 mol-% beträgt.
 9. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 7, bei der die Konzentration des Y₂O₃ 3 bis 6 mol-% beträgt.
 10. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 7, bei der die Konzentration des Y₂O₃ 3 mol-% oder 6 mol-% beträgt.
- 11. Schottky-Émissions-Kathode nach Anspruch 4, bei der das phasenstabilisierende Element oder die Verbindung CaO ist.
- 12. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 4, bei der das phasenstabilisierende Element oder die Verbindung MgO ist.
- 13. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 4, bei der das phasenstabilisierende Element Y₂O₃ ist.
- 14. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 13, bei der das Y_2O_3 in einer Konzentration von 3 bis 8 mol-% vorliegt.
- 15. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 13, bei der das Y_2O_3 in einer Konzentration von 3 bis 6 mol-% vorliegt.
- 16. Schottky-Emissions-Kathode nach Anspruch 13, bei der die Konzentration des Y_2O_3 3 mol-% oder 6 mol-% beträgt.
- 17. Verfahren zur Stabilisierung eines ZrO₂-Vorrats einer Schottky-Emissions-Kathode mit einem Heizfaden und einer eine Facette aufweisenden und mit dem